

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)  
ООО «НПО «Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения»  
ООО «НПО «Измеритель»  
ООО «ФЕРРИ ВАТТ»

Группа компаний «Криосистемы»

Российское научно-техническое вакуумное общество им. акад. С. А. Векшинского  
Проводится при поддержке

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**20–22 июня 2023**  
**Санкт-Петербург, Россия**

**June 20-22, 2023**  
**St. Petersburg, Russia**

30th All-Russian Conference with International Participation  
**«VACUUM TECHNIQUE AND TECHNOLOGY – 2023»**



# Труды 30-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием **«ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ – 2023»**

**20–22 июня 2023 г.**  
**Санкт-Петербург**

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)  
ООО «НПО «Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения»  
ООО «НПО «Измеритель»  
ООО «ФЕРРИ ВАТТ»  
Группа компаний «Криосистемы»  
Российское научно-техническое вакуумное общество им. акад. С. А. Векшинского  
Проводится при поддержке  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**20–22 июня 2023**  
**Санкт-Петербург, Россия**

**June 20-22, 2023**  
**St. Petersburg, Russia**

30th All-Russian Conference with International Participation  
**«VACUUM TECHNIQUE AND TECHNOLOGY – 2023»**



# Труды 30-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием **«ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ – 2023»**

**20–22 июня 2023 г.**  
**Санкт-Петербург**

Вакуумная техника и технологии - 2023. Труды 30-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. 20-22 июня 2023 г./ под ред. Тетерука Р.А., Анцуковой А.И., Шарифуллиной К.Р.– СПб.:Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2023.-397 с.

Труды составлены по материалам докладов, представленных на 30-ю Всероссийскую научно-техническую конференцию с международным участием. В материалах докладов изложены результаты исследований в области физики вакуума, вакуумметрии, масс-спектрометрии и контроля герметичности. Рассмотрены актуальные вопросы получения вакуума, создания вакуумного оборудования и разработки новых технологических процессов. Особое внимание уделено решению задач вакуумной техники в формировании пленок и покрытий плазменными и смежными методами, изучению свойств покрытий и методам их исследования, новым материалам покрытий, в том числе наноматериалам, новым областям их использования, разработке современного оборудования и технологических процессов, применению вакуумных технологий в промышленности и научных исследованиях и, в частности, в атомной промышленности, металлургии и добывающих отраслях.

### **Программный комитет**

Пронин А.Н. – генеральный директор ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» - председатель.

Тетерук Р.А. – руководитель НИО государственных эталонов в области измерений давления ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» – зам. председателя.

Шаповалов В.И. – профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) – сопредседатель по секции «Вакуумная техника».

Розанов Л.Н. – профессор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» – зам. председателя.

Нестеров С.Б. – президент РНТВО имени академика С.А. Векшинского – член оргкомитета.

Полянский В.А. – директор ФГБУН «Институт Проблем Машиноведения Российской Академии Наук» – член оргкомитета.

Чернышенко А.А. – руководитель НИЛ госэталонов и научных исследований в области измерений низкого абсолютного давления (вакуума) ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» – сопредседатель по секции «Контроль герметичности».

Кузнецов В.Г. – руководитель лаборатории ИПМаш РАН - сопредседатель по секции «Вакуумные технологии».

Капустин Е.Н. – генеральный директор ОАО «Вакууммаш» – член оргкомитета.

Марцынюков С.А. – доцент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) – член оргкомитета.

Добречев К.Г. – директор по маркетингу ООО «НПО «Измеритель» – член оргкомитета.

Желонкин Я.О. – генеральный директор ООО «ФЕРРИ ВАТТ» – член оргкомитета.

Бурмистров А.В. – проректор по учебной работе КНИТУ, Россия, Казань – член оргкомитета.

Одиноков В.В. – зам. ген. директора по науке ОАО НИИТМ (Научно-исследовательский институт точного машиностроения), Россия, Москва – член оргкомитета.

Панфилов Ю.В. – зав. кафедрой «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия, Москва – член оргкомитета.

Потрахов Н.Н. – зав. кафедрой «Электронные приборы и устройства» «ЛЭТИ» им. В.И. Улья (Ленина) – член оргкомитета.

Кострин Д.К. – доцент кафедры «Электронные приборы и устройства» «ЛЭТИ» им. В.И. Ульян (Ленина) – член оргкомитета.

Колесник Л.Л. – ученый секретарь РНТВО имени академика С.А. Векшинского – член оргкомитета.

Ответственность за достоверность сведений и сохранение государственной или корпоративной тайны  
несут авторы публикаций.

ISBN 978-5-7629-3204-2

# Содержание

## Секция «Пленарные доклады»

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1. Гордимся прошлым. Создаём будущее. Вакууммашу-80!  | <i>Е. Н. Капустин и А. Е. Капустин</i> | 16 |
| 2. Российское научно-техническое вакуумное общество имени академика С.А. Векшинского.<br>Современное состояние и перспективы развития | <i>С. Б. Нестеров</i>                  | 24 |
| 3. «Послезавтра» вакуумных технологий   | <i>Я. О. Желонкин</i>                  | 30 |

## Секция «Вакуумная техника»

|  |   |    |
|--|---|----|
| 4. Моделирование рабочего процесса бесконтактных вакуумных насосов                                   | <i>А. В. Бурмистров, А. А. Райков, С. И. Саликеев</i>   | 35 |
| 5. Требования к элементной базе газовакуумных систем технологического оборудования                   | <i>С. В. Сажнев</i>   | 40 |
| 6. Вакуумплотная слабо проводящая керамика на основе алюмината бария                                 | <i>А. А. Жданок, Л. К. Бердникова, З. А. Коротаева, Б. П. Толочки, В. В. Булгаков, Д. А. Краснов</i>                                | 43 |
| 7. Вопросы разработки прогреваемых сверхвысоковакуумных разъёмных соединений                         | <i>А. Е. Вязовецкова, В. В. Вязовецков, Л. К. Кузнецова, Ю. С. Шпанский</i>   | 46 |
| 8. Численное моделирование системы откачки вакуумной камеры при импульсно-периодическом<br>натекании | <i>А. А. Моисеев, А. А. Филатов, А. А. Кишалов, П. Г. Смирнов</i>   | 51 |
| 9. Моделирование сверхвысоковакуумной откачки оборудования шлюзового типа                            | <i>Ю. В. Панфилов, Л. Л. Колесник, Г. М. Сокол, А. Тымина</i>   | 55 |
| 10. Вакуумная техника в производстве и применении гиротронов   | <i>А.П. Фокин, А.А. Ананичев, М.Д. Проявин, А.Н. Куфтин, Е.В. Пияшова, С.Ю. Корнишин,<br/>Е.А. Солуянова, Е.М. Тай, М.Ю. Глявин</i> | 60 |
| 11. Насосы сверхвысоковакуумные производства ООО «Катод»   | <i>Н.Б. Кислый, П.Г. Нечаев</i>   | 64 |

## Секция «Вакуумные технологии»

|   |   |    |
|---|---|----|
| 12. О важности проведения подструживания расплава при индукционной плавке и гомогенизации<br>литка под прокатку листов и лент из сплава 29НК-ВИ                 | <i>П.А. Головкин</i>  | 72 |
| 13. Кинетическая теория разлёта плазмы катодного факела   | <i>В. Ю. Кожевников, А. В. Козырев, А. О. Коковин, Н. С. Семенюк, В. С. Игумнов</i> | 79 |
| 14. Влияние давления в рабочей камере технологической установки на взаимодействие плазмы с<br>поверхностью изделия при низкотемпературном плазменном упрочнении | <i>Б. М. Бражзовский, Е. П. Зинина и В. В. Мартынов</i>                             | 84 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 15. | Разработка манипулятора для обработки кремниевых пластин в вакуумной камере<br><i>Д. К. Капустин, И. А. Белянов, А. А. Осипов</i>  | 88  |
| 16. | Применение вакуумных технологий в производстве теплоизолированных труб<br><i>В. Г. Дураков</i>   | 93  |
| 17. | Изучение влияния расхода кислорода на скорость осаждения покрытия на основе Zr-Y при магнетронном распылении с охлаждаемой мишенью<br><i>Г. В. Качалин, А. Ф. Медников, К. С. Медведев, А. И. Бычков и О. С. Зилова</i>      | 98  |
| 18. | Деарсениация золотосодержащих концентратов в вакууме без принудительного перемещения дисперсной среды<br><i>С. А. Требухов, В. Н. Володин, А. В. Ниценко, К. А. Линник, Е. А. Гапуров</i>                                    | 104 |
| 19. | Распределение редких элементов при вакуум-дистилляционной переработке полиметаллических штейнов<br><i>В. Н. Володин, С. А. Требухов, А. В. Ниценко, А. А. Требухов, Ф. Х. Тулеутай</i>                                       | 110 |
| 20. | Анализ температурных условий в растущем покрытии и подложке в процессе реализации вакуумнодугового ионноплазменного (arc-PVD) метода<br><i>А. В. Черногор, Д. С. Белов, А. П. Демиров, И. В. Блинков</i>                     | 114 |
| 21. | Разработка исследовательского CVD оборудования<br><i>О. Ю. Гончаров, Л. Х. Балдаев</i>   | 118 |
| 22. | Фото- и радиационно-индуцированный катализ с применением наночастиц FexOy<br><i>С. Ю. Соковнин, А. С. Герасимов, М. Е. Балезин</i>   | 124 |
| 23. | Влияние постоянного магнитного поля на фотолюминесценцию нанофторидов бария и кальция<br><i>С. Ю. Соковнин, В. Г. Ильвес, М. Г. Зуев</i>   | 129 |
| 24. | Влияние технологических параметров нанесения на структуру и свойства катодно-дуговых четырехэлементных покрытий Al-Cr-B-N<br><i>В. А. Латыцкая, Т. А. Кузнецова, Б. Вархолински, А. В. Хабарова, А. Гилевич, С. А. Чижик</i> | 135 |
| 25. | Анализ кинетики нагревания подложки при магнетронном распылении сэндвич мишени медь-титан<br><i>М. О. Иванцов, В. И. Шаповалов</i>   | 138 |
| 26. | Организация промышленного производства отечественных установок молекулярного наслаждания проточно-вакуумного типа<br><i>В. В. Антипов, В. С. Балахнин, В. А. Гладченко, А. А. Малков, А. В. Москалев, А.А. Малыгин</i>       | 144 |
| 27. | Исследование фазового состава плазменного покрытия системы ZrO <sub>2</sub> - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><i>А. Л. Митрофанов, А. А. Лозован, С. Я. Бецоффен, А. С. Ленковец</i>                                       | 150 |
| 28. | Низкотемпературное ионное азотирование титанового сплава ВТ6<br><i>А. Ф. Тагиров, Р. Д. Агзамов</i>  | 154 |
| 29. | Разработка технологии вакуумного нанесения пассивационных слоев для резонаторов инжекционных лазеров<br><i>А. В. Фомин, Е. А. Анашкин, М. В. Лупачев, Е. М. Филоненко</i>  | 158 |
| 30. | Разработка режимов высокоэнергетической обработки в вакууме тонкопленочных резистивных слоев на основе сплава П65ХС<br><i>В. Д. Зуев, А. А. Рыжков, Д. В. Дерябин, С. А. Гурин, М. Д. Новичков</i>                           | 164 |

|   |     |
|---|-----|
| 31. Применение магнетронного распыления для формирования многослойных структур AlNi<br>Д. Е. Шашин, Н. И. Сушенцов, А. Д. Дьячков, П. Г. Габдуллин, О. Е. Квашенкина, В. Е. Бабюк   | 170 |
| 32. Использование имитационных моделей Монте-Карло для подбора траектории перемещения модельного блиска при нанесении покрытия из плазмы вакуумно-дугового разряда<br>А. В. Олейник, К. Н. Рамазанов  | 175 |
| 33. Опыт и перспективы использования низкотемпературного химического осаждения из газовой фазы вольфрама и его соединений для улучшения эксплуатационных свойств изделий<br>В. А. Смирнов, А. Н. Пацков, С. А. Ващин, В. В. Душик, А. А. Шапоренков, С. В. Евсеев | 180 |
| 34. Разработка установки реактивного магнетронного распыления промышленного типа<br>И. А. Белянов, Д. К. Капустин, А. А. Осипов   | 184 |
| 35. Структура и свойства покрытия Al-Mg-B, сформированного ионно-плазменным методом на поверхности высокоэнтропийного сплава<br>Ю. Ф. Иванов, В. В. Шугуров, И. И. Ажажса, Е. А. Петрикова, О. С. Толкачев  | 189 |
| 36. Структура и свойства покрытий TiN и AlN, нанесенных магнетронным методом, при изменении потока азота в камере<br>А. В. Хабарова, В. А. Лапицкая, А. Л. Николаев, Е. В. Садырин, С. М. Айзикович, С. А. Чижик  | 193 |
| 37. Моделирование теплового процесса при магнетронном распылении в аргоне сэндвич мишени Ti/Cu<br>Д. С. Шарковский, В. И. Шаповалов   | 197 |
| 38. Разработка установки газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений для выращивания GaN на кремнии<br>М. Г. Бирюков, П. Е. Афонин, С. А. Щуренкова, Д. Ю. Пугачев, В. В. Лундин, Е. Е. Заварин, А.Ф. Цацульников, Д. С. Базаревский, Е. А. Калаушина  | 202 |
| 39. Свойства плёнок Nb <sub>3</sub> Sn, полученных с помощью одновременного дугового и магнетронного напыления<br>Ю. Н. Юрьев, А. В. Юрьева, А. И. Савельев   | 206 |
| 40. Роль фаз c-Ti0,5Al0,5N, c-AlN, c-TiN и ε-Al2Ti в увеличении защитного эффекта покрытий Ti1-xAlxN (x<0.6) и AlN в 3% растворе NaCl<br>А.Л.Каменева, В.Ф. Маточкин  | 210 |
| 41. Ламинированный текстильный материал с экранирующими свойствами<br>А. Е. Карноухов, Э. Ф. Вознесенский, Ю. А. Тимошина, Я. О. Желонкин   | 216 |
| 42. Вакуумно-плазменная технология модификации наполнителей для композиционных материалов<br>В. А. Стратанович, Л. Ф. Иванов  | 220 |
| 43. Исследования по получению сварных металлокерамических соединений методом диффузионной сварки<br>М.С. Клокова, Г. В Рогожин  | 224 |
| 44. Изготовление лазерных зеркал с радиально зависимым коэффициентом отражения<br>В. Н. Горнов, А. И. Арефьев, Ю. Ю. Смирнов, А. П. Котов, Р. А. Бызов  | 228 |

|   |     |
|---|-----|
| 45. Определение термических коэффициентов линейного расширения в покрытиях<br>А. А. Лозован, С. Я. Бецофен, А. А. Ашмарин, А. С. Ленковец,<br>А. Н. Быкадоров, А. Л. Митрофанов   | 233 |
| 46. Влияние скорости вращения подложки и порядка нанесения слоев на характеристики многослойных покрытий TiN/Cu/InSn<br>А. А. Лозован, С. Я. Бецофен, С. В. Савушкина, М. А. Ляховецкий, Е. П. Кубатина   | 237 |
| 47. Многослойные композитные Ta/W покрытия, напыленные системой инвертированных магнетронов<br>А. А. Лозован, С. Я. Бецофен, А. С. Ленковец, Н. А. Иванов, Е. М. Рыбаков  | 240 |
| 48. Исследование зависимости структуры покрытия от режимов нанесения методом магнетронного распыления для сыпучих материалов<br>К. Н. Каримов, Э. Ф. Вознесенский, Я. О. Желонкин   | 244 |
| 49. Получение покрытий Ti-Al-Ta-Si-N методом реактивного магнетронного распыления<br>Е.Д. Кузьминов, А.Р. Шугуров, Ю.А. Гаранин   | 248 |
| 50. Магнетронное осаждение CrAlN покрытий с плазменным ассистированием<br>Д. В. Сиделёв, Е. С. Осипова  | 252 |
| 51. Тенденции развития технологий вакуумного корпусирования микросистем с применением газопоглотителей<br>А.Н. Бойко  | 257 |
| 52. Формирование антиотражающего покрытия нитрида алюминия на экранах электронно-оптических преобразователей методом реактивного магнетронного распыления<br>Р. А. Каракулов, Д. Д. Зыков, Р. И. Нуртдинов, А. Ю. Соколов, П. И. Коновалов, Е. Н. Фёдоров | 258 |
| 53. Разработка покрытий для защиты авиационного остекления из поликарбоната от внешних факторов<br>Буднев А.Ю., Просовский О.Ф., Исамов А.Н., Просовский Ю.О., Смольянинов В.А.   | 266 |
| 54. Перспективные разработки АО ОНПП Технология им. А.Г.Ромашина в области конструкционной и приборной оптики<br>Просовский О.Ф., Петраков Д.Н., Хмельницкий А.К., Просовский Ю.О., Буднев А.Ю., Исамов А.Н., Смольянинов В.А.                            | 273 |
| 55. Технология получения сложных многослойных интерференционных покрытий<br>Просовский Ю.О., Просовский О.Ф., Буднев А.Ю., Исамов А.Н., Смольянинов В.А.  | 279 |
| 56. Динамика изменения давления в камере плазменного фокуса в течение высоковольтной тренировки<br>Михайлов Ю.В., Прокуратов И.А.   | 285 |
| <b>Секция «Вакуумные измерения»</b>   |     |
| 57. Проблемы метрологического обеспечения крупногабаритных имитаторов солнечного излучения для термовакуумных испытаний<br>А. А. Шевчук, О. В. Пастушенко, В. В. Двирный и А. К. Шаров  | 287 |
| 58. Перспективы развития жидкостной манометрии в области низкого абсолютного давления (0,1 – 1000 Па)<br>Т.А. Эйхвальд  | 292 |
| 59. Научно-методические принципы технических решений увеличения эффективности метрологического обеспечения в области измерений низкого абсолютного давления вакуума<br>Д. Е. Сенатов, Р. Э. Кувандыков, Р. А. Тетерук, А. А. Чернышенко                   | 297 |

**Секция «Контроль герметичности»**

|  |     |
|--|-----|
| 60. Испытания на герметичность разъемного соединения прототипа первой стенки ИТЭР масс-спектрометрическим методом течеискания<br>Н. В. Монтах, П. Ю. Пискарев, В. А. Васильев, Д. А. Киселев,<br>М. С. Колесник, С. Н. Мазаев и А. С. Швертчко | 303 |
| 61. Исследование термоэлектронной эмиссии ЭВП после герметизации течей<br>Г. А. Жабин, С.А. Вашин, Е.А. Стройков   | 308 |
| 62. Основные проблемы современных отечественных средств измерений, применяемых при контроле герметичности масс-спектрометрическим методам<br>Д. М. Фомин   | 313 |
| 63. Применение масс-спектрометрии для оптимизации процесса термовакуумной обработки ЭВП СВЧ<br>Д. К. Черченко, Ю. Н. Парамонов, Д. А. Калашников, В. М. Саблин   | 317 |

**Секция «Вакуумные технологии в космической и атомной отраслях»**

|   |     |
|---|-----|
| 64. Наземный измерительно-калибровочный комплекс на основе крупногабаритной криогенно-вакуумной камеры для радиометрической калибровки аппаратуры ДЗ3<br>С. М. Зорин, Д. О. Трофимов, Ю. М. Гектин  | 323 |
| 65. Вакуумные камеры для охлаждения ФПУ в составе комплекса аппаратуры для наземных испытаний астрофизической обсерватории «Спектр-УФ»<br>Г. М. Бубнов, В. Ф. Вдовин, А. И. Елисеев, В. В. Корчагин,<br>И. В. Леснов, М. А. Мансфельд, Н. В. Тятошкин | 331 |
| 66. Термовакуумная камера для испытаний с расширенным диапазоном температур<br>А.Ю. Кочетков  | 336 |
| 67. Применение газопоглотителей водорода при вакуумных испытаниях внутrikамерных компонентов реактора ИТЭР<br>Д. А. Киселев, А. Н. Маханьков, С. Н. Мазаев, В. А. Васильев  | 340 |
| 68. Вызовы и решения на пути создания особо крупногабаритных стендов для термовакуумных и термобалансных испытаний космических аппаратов для перспективных космических миссий<br>Д. Е. Алфимов, С. Б. Нестеров, А. А. Филатов                         | 347 |
| 69. Испытательные стенды наземной экспериментальной отработки космических и летательных аппаратов<br>Д. Е. Алфимов  | 351 |
| 70. Стенд для имитации солнечного ветра: анализ требований, области применения и метрологическое обеспечение<br>Е. А. Шилов, А. А. Филатов, А. А. Кишалов, П. Г. Смирнов, А. А. Моисеев   | 357 |
| 71. Компьютерное моделирование и экспериментальная отработка перспективных систем инфракрасного нагрева: на пути к созданию виртуальной лаборатории термовакуумных испытаний<br>А. А. Филатов, А. А. Кишалов, П. Г. Смирнов, А. А. Моисеев            | 361 |

|   |     |
|---|-----|
| 72. Численное моделирование и экспериментальная валидация ИК нагревателей различной формы<br><i>A. A. Mouseev, A. A. Filatov, A. A. Kishalov, P. G. Sмирнов</i>   | 367 |
| 73. Статус работ по вакуумной системе инжектора СКИФ<br><i>A. M. Семенов, В. В. Анашин, Л. Л. Белова, А. Н. Журавлев, А. А. Краснов, В. С., Кузьминых, А. Е. Левичев, Е. Б. Левичев, О. И. Мешков, О. А. Павлов, П. А. Пиминов, С. В. Синяткин</i>                    | 374 |
| 74. Оптимизация системы откачки и расчёт динамического давления в накопителе СКИФ<br><i>B. В. Анашин, В. А. Кайгородцев, А. А. Краснов</i>  | 379 |
| 75. Development of vacuum equipment for sub-terahertz astronomy and space missions<br><i>A. N. Chernikov, A. A. Gunbina, V. S. Edelman, A. I. Eliseev, A. Krasilnikov, I. V. Lesnov, M. A. Mansfeld, N. V. Tyatyushkin, E. L. Pevzner, A. V. Vdovin, V. F. Vdovin</i> | 384 |
| 76. Реактивное магнетронное распыление<br><i>B. И Шаповалов</i>   | 389 |